Квантовая эффективность и формирование линии излучения в светодиодных структурах с квантовыми ямами InGaN/GaN

© Н.И. Бочкарева[¶], Д.В. Тархин, Ю.Т. Ребане, Р.И. Горбунов, Ю.С. Леликов, И.А. Мартынов, Ю.Г. Шретер

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 30 мая 2006 г. Принята к печати 19 июня 2006 г.)

Исследованы спектры электролюминесценции, фотолюминесценции и фототока в структурах с квантовыми ямами $In_{0.2}Ga_{0.8}N/GaN$ с целью выяснения причин падения квантовой эффективности с увеличением прямого тока. Установлено, что квантовая эффективность падает, когда энергия излучаемого фотона приближается к порогу подвижности в слое $In_{0.2}Ga_{0.8}N$. Порог подвижности, определенный из спектров фототока, составил $E_{me} = 2.89$ эВ. При энергиях hv > 2.69 эВ носители заряда имеют вероятность туннелировать на безызлучательные центры рекомбинации, поэтому время жизни и квантовая эффективность падают. Туннельная инжекция в глубокие локализованные состояния обеспечивает максимальную эффективность электролюминесценции, что объясняет причину характерного максимума эффективности светодиодов при плотностях тока, значительно меньших, чем рабочие. Заселение глубоких локализованных состояний в "хвостах" плотности состояний InGaN играет также доминирующую роль в формировании линии излучения. Обнаружено, что рост эффективности и "красный" сдвиг спектра ФЛ с напряжением коррелирует с изменением фототока и связаны с уменьшением разделения фотоносителей в поле области объемного заряда и их термализацией в глубокие локализованные состояния.

PACS: 73.40.Kp, 73.63.Hs, 78.55.Cr, 78.60.Fi, 78.67.De, 85.60.Jb

1. Введение

Высокую квантовую эффективность излучения квантовых ям InGaN/GaN в литературе часто связывают с локализацией экситонов на флуктуациях потенциала в активном слое InGaN и на интерфейсах InGaN/GaN [1-5]. Неоднородные флуктуации потенциала могут быть вызваны флуктуациями состава или разделением фаз в слое InGaN, а также другими несовершенствами кристалла, которые приводят к локальным флуктуациям ширины запрещенной зоны в плоскости слоев InGaN и образованию "хвостов" плотности состояний [6-8]. Экспериментально в активном слое InGaN наблюдались как крупномасштабные неоднородности размерами ~ 1 мкм, так и мелкомасштабные неоднородности размерами < 20-60 нм, обогащенные по составу In [6-7,9]. Считается, что локализация носителей заряда подавляет латеральную диффузию к центрам безызлучательной рекомбинации, включая дислокации, границы зерен или раздела фаз, и обеспечивает высокую квантовую эффективность светодиодов на основе нитрида галлия. Конкурирующим механизмом, уменьшающим перекрытие волновых функций электрона и дырки в квантовой яме, является встроенное пьезоэлектрическое поле, возникающее в процессе роста из-за напряжения, вызванного рассогласованием решеток InGaN и GaN и направленное противоположно полю области объемного заряда [10].

Степень влияния каждого из этих механизмов на характеристики электролюминесценции (ЭЛ) и фотолюминесценции (ФЛ) структур InGaN/GaN остается неопределенной. Многие экспериментальные факты находят качественное объяснение в рамках обоих механизмов.

Так, наблюдавшийся в ряде работ стоксов сдвиг между линией излучения и краем спектра поглощения или фототока объясняется возможностью излучать фотоны с меньшей энергией, чем поглощенные, в результате перекрытия между волновыми функциями электрона и дырки, пространственно разделенными пьезоэлектрическим полем в активном слое InGaN [11] или локализацией оптически генерированных носителей заряда в потенциальных минимумах [12]. "Голубой" сдвиг спектра излучения с увеличением уровня оптической или электрической инжекции объясняется заполнением "хвоста" плотности состояний [13] либо экранированием внутреннего электрического поля генерированными носителями заряда [2,10]. В то же время "красный" сдвиг спектра ФЛ, наблюдающийся при росте прямого смещения, объясняют увеличением электрического поля в квантовой яме InGaN/GaN [14].

Однако в литературе уделяется значительно меньше внимания механизму и эффективности электрической и оптической инжекции носителей заряда в активную область. Такие исследования способны дать информацию о механизме излучения и необходимы для совершенствования твердотельных источников освещения на основе структур InGaN/GaN. Между тем даже в высокоэффективных структурах InGaN/GaN квантовая эффективность максимальна при токах инжекции, составляющих 0.01-0.1 от рабочего тока светодиодов, и падает при плотности тока $> 0.4 - 4 \text{ A/cm}^2$ [15]. Ранее в литературе падение коэффициента инжекции с ростом прямого тока связывалось с неэффективным захватом электронов в квантовую яму InGaN/GaN и их инжекцией в p-GaN [15]. Однако, как было показано в работе [16], при типичной для эффективных структур

[¶] E-mail: n.bochkareva@mail.ioffe.ru

89

плотности дырок в слоях *p*-GaN и *p*-AlGaN, равной $N_p = 3 \cdot 10^{17} - 10^{18} \text{ см}^{-3}$ [17], "перетекание" электронов "над" квантовой ямой в слой *p*-GaN пренебрежимо мало при плотности тока < 10^3 A/cm^2 . В работе [18] рост инжекционных потерь с напряжением связывался нами с доминированием туннелирования электронов на состояния интерфейсов InGaN/GaN и их безызлучательной рекомбинацией с дырками.

Цель настоящей работы — исследовать механизм формирования линии излучения в структурах с квантовыми ямами In_{0.2}Ga_{0.8}N/GaN и выяснить его роль в падении эффективности электролюминесценции с увеличением прямого тока. С этой целью в работе проведены измерения спектров электролюминесценции, фотолюминесценции и фототока при прямых смещениях структур In_{0.2}Ga_{0.8}N/GaN и проанализирован вклад механизмов инжекции в основные характеристики ЭЛ и ФЛ.

2. Эксперимент

Исследовались структуры *p*-GaN/In_{0.2}Ga_{0.8}N/GaN/ *n*-GaN с активным слоем In_{0.2}Ga_{0.8}N/GaN толщиной 30 Å, изготовленные методом MOCVD. Структуры содержали полупрозрачный контакт Ni/Au к слою *p*-GaN и контакт Al/Ti к слою *n*-GaN. Детали структуры приведены в [19]. Реальная площадь структур $S = 6 \cdot 10^{-4}$ см². Квантовая эффективность структур составила 7% при прямом смещении U = 3 В и токе 20 мА, длина волны в максимуме спектра излучения составила 465 нм при полуширине спектра 20 нм.

Фотолюминесценция возбуждалась Не–Сd-лазером мощностью 20 мВт на длине волны $\lambda = 325$ нм ($h\nu = 3.81$ эВ) при диаметре пучка 0.9 мм. Измерения спектров фотолюминесценции и электролюминесценции проводились на спектрометре AvaSpec-2048. Измерения спектров фототока проводились при освещении структур монохроматическим светом лампы накаливания с помощью монохроматора МДР-2.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

3.1. Спектры излучения и фототока

На рис. 1, а представлены спектры ФЛ и ЭЛ, измеренные при прямом напряжении 2.23 и 2.6 В соответственно, и спектр фототока короткого замыкания. Представленные спектры ФЛ и ЭЛ имеют близкие положения максимума излучения ($hv_{max} = 2.61$ эВ) и полуширину. В спектре ФЛ наблюдается также полоса "желтой" люминесценции, связанная с присутствием дефектов в слое GaN. Спектры излучения сдвинуты к меньшим энергиям относительно спектра фототока короткого замыкания $I_{sc}(hv)$. При $hv < hv_{max} = 2.61$ эВ величина фототока резко падает.



Рис. 1. a — спектры фотолюминесценции (I), электролюминесценции (2) и фототока короткого замыкания (точки — эксперимент, сплошная кривая — результат подгонки по формуле (1)) (3) структуры In_{0.2}Ga_{0.8}N/GaN. U, B: I — 2.23, 2 — 2.6. I, мА: I — 9.4 \cdot 10⁻³, 2 — 2.2. b — зависимость квантовой эффективности структуры In_{0.2}Ga_{0.8}N/GaN от прямого напряжения.

Спектр фототока, пропорционального коэффициенту поглощения, имеет вид, характерный для уширения края поглощения с экспоненциально спадающими хвостами плотности состояний [12,20]:

$$I_{\rm sc}(h\nu) \propto \left[1 + \exp\{(E_{\rm me} - h\nu)/E_U\}\right]^{-1},$$
 (1)

где $E_{\rm me}$ — порог подвижности ("эффективная ширина запрещенной зоны" в активном слое $In_{0.2}Ga_{0.8}N$), E_U — энергия локализации, определяющая уширение спектра и эквивалентная урбаховской энергии. Эксперименталь-

ный спектр фототока хорошо описывается этим соотношением при $E_{\rm me} = 2.89$ эВ и $E_U = 61$ мэВ. В результате стокосов сдвиг между краем поглощения и энергией пика ЭЛ составляет 0.23 эВ.

На рис. 1, *b* представлена зависимость квантовой эффективности структуры η от прямого смещения. Максимальная квантовая эффективность наблюдается при напряжении $U = 2.6 \,\mathrm{B}$ и токе 2 мА и составила $\eta_{\rm max} = 10.5\%$. При увеличении напряжения до рабочего напряжения в светодиодах U = 3 B и тока до 20 мAквантовая эффективность падает до $\eta = 0.66 \eta_{\text{max}} = 7\%$.

3.2. Немонотонное увеличение прямого тока при освещении

На рис. 2 представлены зависимости тока от напряжения, измеренные без освещения (кривая 1) и при освещении лампой накаливания (кривые 2-4). В идеальной *p*-*n*-структуре при прямом смещении световой ток $I_L(U, L)$ равен сумме прямого тока I(U), не зависящего от интенсивности света L, и фототока $I_{sc}(L)$, не зависящего от напряжения: $I_L(U, L) = I(U) - I_{sc}(L)$. Из рис. 2 видно, что световой ток уменьшается с напряжением быстрее, чем растет темновой ток, так как прямой

2

1

4

3

2



освещенной лампой накаливания (2-4) структуры И In_{0.2}Ga_{0.8}N/GaN. Вставка — изменение наклона характеристик $\log I(U)$ (1) и $\log I_L(U)$ (2) с увеличением прямого напряжения. Интенсивность света, мBT/см²: 2 - 20, 3 - 50, 4 - 100.



Рис. 3. Зависимости прямого тока (1), увеличения прямого тока ΔI_L (2) и интенсивности фотолюминесценции (3) при лазерном возбуждении, интенсивности электролюминесценции (4), энергии пиков спектров $\Phi \Pi$ (5) и $\Im \Pi$ (6) от прямого напряжения.

ток I_{FL} немонотонно увеличивается при освещении: $I_{FL}(U,L) = I(U) + \Delta I_L(U,L).$

Немонотонное поведение светового тока с напряжением наблюдалось и при лазерном возбуждении ФЛ $(h\nu > E_g^{\text{GaN}})$. При лазерном возбуждении наблюдался фототок $I_{\text{sc}} = 40$ мкА. Так как прямой ток неосвещенной структуры при U < 2 В меньше 1 мкА, в идеальной *p*-*n*-структуре световой ток должен был бы отличаться от $I_{\rm sc}$ не более, чем на 1 мкА до $U \approx 2$ В. Следовательно, по крайней мере при U < 2 В прямое смещение не должно было бы оказывать заметного влияния на разделение носителей заряда, генерированных светом. На рис. 3 представлены зависимости прямого тока (кривая 1) и разности между прямыми токами освещенной и неосвещенной структур $\Delta I_L(U) \equiv I_L(U) + I_{sc} - I(U)$ (кривая 2) от прямого смещения. На кривой $\Delta I_L(U)$, как и при освещении светом с энергиями фотонов $hv < E_{\rho}^{\text{GaN}}$, отчетливо видны перегибы вблизи 0.5 и 1.5 В, где ток слабее растет с напряжением.

Величина фотоэдс холостого хода составила $U_{\rm oc} = 2.28$ В. Отметим, что в отсутствие влияния освещения на величину прямого тока и $\Delta I_L(U) = 0$ при $I_{\rm sc} = 40$ мкА равенстов $I(U) = I_{\rm sc}$ достигалось бы при большей величине фотоэдс $U_{\rm oc} = 2.36$ В.

Избыточный ток структур с квантовыми ямами InGaN/GaN, наблюдающийся при напряжениях, меньших напряжения U_{EL}, при котором обнаруживается ЭЛ, связывают с туннелированием носителей заряда в локальных дефектных областях [21-23]. В работе [18] избыточный ток связывается с туннелированием электронов на состояния, локализованные на интерфейсах InGaN/GaN, и их рекомбинацией с дырками. Дифференцирование кривых $\log \Delta I_L(U)$ и $\log I(U)$ (см. вставку к рис. 2) показывает, что уменьшение их